



所谓偏光解析系统

通过测定并分析偏光状态，可以了解物质内部的状态，或表面性状，或光学特性等。
西格玛光机推荐的自动偏光解析系统是一套标准化了的光源，光器件，支架平台，测量仪和软件的组合。
它既可完成简易的偏光测量，也可以改装为专用的测定装置，应用广泛。

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

显微镜

光通讯

干涉仪

检查 / 观察

生物光学

激光加工

偏光测量软件

■ 简易偏光解析软件 [SimpleAPAS]

可实现激光等特定波长的消光比，相位差测定，也可组合到客户的应用程序中去。

【主要功能】

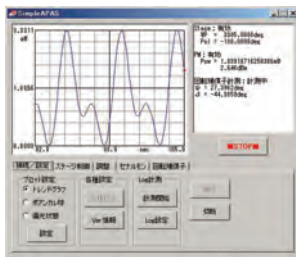
- 波长板，检偏器光轴的自动调整
- 塞拿蒙补偿 (Senarmont compensator) 测量相位差
- 转动补偿器方式的偏光计测和相位差测量
- 各种过程计测

■ 综合偏光解析软件 [SKPola]

使用紫外，可见或近红外光源，配合专用的光学系统，可分析分光数据特性。
对应单一波长测定和分光测定，还可以测定高次相位差，可完成偏光光学零件的主要技术指标的评估。

【主要功能】

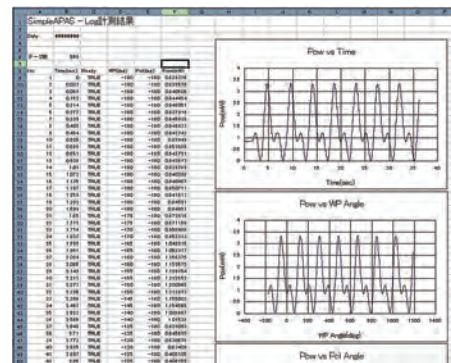
- 偏光光学零件光轴的自动调整
- 塞拿蒙补偿 (Senarmont compensator) 测量相位差
- 转动补偿器方式的偏光计测
- 转动检片器补偿方式的偏光计测
- 圆偏光对比度测量
- 偏光器透过偏光比测定
- 分光透过率测定
- 各种过程计测



消光比测定



庞加莱 (Poincaré) 球显示



把测量数据传送给其他表计算软件

偏光测定应用例

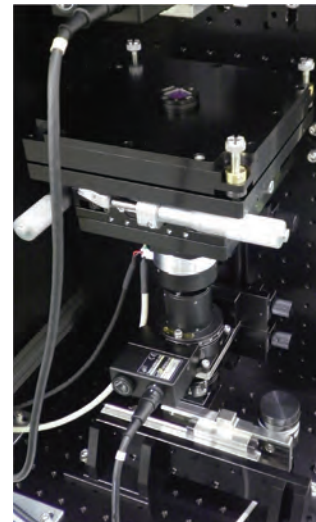
承接客户定制，或新产品开发。



偏光膜透过偏光比测定装置



附带同轴观测系统的相位差测定装置



圆偏光测定装置